

関係各位

ナノ・マイクロマテリアル分析研究室  
運営責任者 大貫 惣明

光電子分光分析研究室  
運営責任者 坂入 正敏

【2014年度 施設利用説明会（合同）の実施について】

当研究室は微小部・表面分析を行うための各種電子顕微鏡・分光分析装置を有する全学共同利用施設です。本年度の施設利用説明会を下記のとおり実施しますので、ご案内いたします。なお、両設備群ともX線発生装置には指定されていませんので、障害防止規定で要請されている「安全講習ではありません」。しかし、ご出席いただき設備の概要をご理解ください。利用講習は別途に、随時行います。

<2014年度施設利用説明会>

日付：5月28日(水)

時間：16時30分～18時00分（5時限目）

場所：工学部 材料化学実験棟 3階 MC030 大講義室

内容：①説明会概要

②北大微細構造解析(ナノテク)プラットフォームについて

③各装置の概要と測定例

④その他

※ 学生、研究員への連絡につきましては、教職員からお願いします。

<ナノ・マイクロマテリアル分析研究室 共同利用装置一覧>

- ◎ FE-EPMA (電子プローブマイクロアナライザ)
- ◎ FIB-SEM (収束イオンビーム加工・観察装置)
- ◎ FE-SEM (走査電子顕微鏡)
- ◎ TEM (透過電子顕微鏡)
- ◎ XRF (蛍光X線分光装置)
- ◎ 試料作製機器

<光電子分光分析研究室 共同利用装置一覧>

- ◎ XPS (光電子分光装置)
- ◎ AES (オージェ電子分光装置)
- ◎ LV-SEM (走査電子顕微鏡)
- ◎ 試料作製機器

<連絡先>

工学研究院 全学共同利用施設 ナノ・マイクロマテリアル分析研究室  
施設職員 宮崎・遠堂 e-mail: [info-nma@eng.hokudai.ac.jp](mailto:info-nma@eng.hokudai.ac.jp)

TEL:011-706-6363

工学研究院 全学共同利用施設 光電子分光分析研究室  
施設職員 鈴木 e-mail: [suzuki-k@eng.hokudai.ac.jp](mailto:suzuki-k@eng.hokudai.ac.jp)

TEL:011-706-6882

以上